**2020年度 総合地球環境学研究所 同位体環境学共同研究 承諾書**

（西暦）　　　年　　　月　　　日

総合地球環境学研究所　所長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　申請者（研究代表者※）の所属

　　　　　　　　　　　　　　 　 職 名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先　　電話

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ

　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail アドレス

同位体環境学共同研究事業公募要領の記載事項および下記の内容に同意のうえ、貴研究所で研究することを承諾します。

※大学または研究機関に所属する研究者の方の研究活動であることを誓約します。

**研 究 題 目**

**研 究 期 間**（西暦） 　　年　　月　　日　　～　2021 年　3　月　31　日

**研 究 組 織**（様式２-２に記載して下さい）

申請者が貴研究所において研究に従事することを承諾します。

（西暦） 　　　年　　　月　　　日

申請者の所属長　職・氏名

印

**研究組織一覧　（地球研実験施設を使用される共同研究者の氏名を下表に記入してください）**

■研究者（常勤・非常勤職員、学振特別研究員（PD,、DC1、DC2を問わない）、COE研究員、教務補佐員等）の方は、お名前の右肩に丸印を付けてください。

■共通機器名および装置使用経験欄には、地球研実験施設の使用を予定している方全員の使用希望装置（申請書（別紙・様式１または様式４）に記載されているもの）ならびにその使用経験の有無をご記入ください。他機関で同様の装置を使用した経験の有無についても、併せてご記入ください。なお、一装置につき一行ご使用ください。

※学生及び大学研究者に準じる方

共同研究開始までに，「学生教育研究災害傷害保険」又は同等以上の傷害保険に加入することを誓約します。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **所属（職または学年も）** | **共通機器名（略称可）**  ※表の下部にある共通機器名称を参照のこと | **共通機器使用経験の有無**（「有」または「無」のいずれかを削除してください） |
| **氏名** | **他機関での同様装置使用経験の有無** |
|  |  | 地球研での使用経験：有・無 |
|  | 他機関での同様装置使用経験：有・無 |
|  |  | 地球研での使用経験：有・無 |
|  | 他機関での同様装置使用経験：有・無 |
|  |  | 地球研での使用経験：有・無 |
|  | 他機関での同様装置使用経験：有・無 |
|  |  | 地球研での使用経験：有・無 |
|  | 他機関での同様装置使用経験：有・無 |
|  |  | 地球研での使用経験：有・無 |
|  | 他機関での同様装置使用経験：有・無 |
|  |  | 地球研での使用経験：有・無 |
|  | 他機関での同様装置使用経験：有・無 |
|  |  | 地球研での使用経験：有・無 |
|  | 他機関での同様装置使用経験：有・無 |
|  |  | 地球研での使用経験：有・無 |
|  | 他機関での同様装置使用経験：有・無 |
|  |  | 地球研での使用経験：有・無 |
|  | 他機関での同様装置使用経験：有・無 |
|  |  | 地球研での使用経験：有・無 |
|  | 他機関での同様装置使用経験：有・無 |
|  |  | 地球研での使用経験：有・無 |
|  | 他機関での同様装置使用経験：有・無 |

（西暦）　　　年　　　月　　　日

申請者の所属・職名・氏名

印

（記入例）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **所属（職または学年も）** | **共通機器名（略称可）**  ※表の下部にある共通機器名称を参照のこと | **共通機器使用経験の有無**（「有」または「無」のいずれかを削除してください） |
| **氏名** | **他機関での同様装置使用経験の有無** |
| 地球大学・教授 | MC-ICP-MS | 地球研での使用経験：有 |
| 地球　研一郎○ | 他機関での同様装置使用経験： 有 |
| 地球大学・教授 | 誘導結合プラズマ質量分析装置 (ICP-MS) | 地球研での使用経験：無 |
| 地球　研一郎○ | 他機関での同様装置使用経験： 有 |
| 地球大学・修士課程　1年 | 誘導結合プラズマ質量分析装置 (ICP-MS) | 地球研での使用経験：無 |
| 上賀茂　さくら | 他機関での同様装置使用経験： 無 |

共通機器についてはHP（http://www.chikyu.ac.jp/laboratories/labo\_shisetsu\_top.html）をご覧ください。

　　　※共通機器名称【略称】：

走査型電子顕微鏡【SEM】

マイクロダイセクター

高精度マイクロミルシステム

多機能型顕微鏡

マイクロ波試料前処理装置

ガンマ線スぺクトロメーター【γ線】

表面電離型質量分析装置【TIMS】

高分解能マルチコレクター誘導結合プラズマ質量分析装置【MC-ICP-MS】

誘導結合プラズマ質量分析装置【ICP-MS)

元素分析装置付き安定同位体比質量分析計（EA-IRMS）【CN-IRMS】

オンラインガス調製/導入システム付き安定同位体比質量分析計（GB-IRMS）【炭酸塩-IRMS】

熱分解型元素分析装置付き安定同位体比質量分析計（TC/EA-IRMS）【有機物OH-IRMS】

元素分析装置付き安定同位体比質量分析計（EA-IRMS）【S-IRMS】

誘導結合プラズマ発光分光分析装置【ICP-AES】

水同位体分析装置【Picarro】

イオンクロマトグラフ

低温灰化装置

試料微粉砕装置

試料粉砕装置ミキサーミル

試料切断研磨装置